

設備利用研修会「蛍光 X 線分析装置による膜厚測定」

物質に X 線を当てることで発生する蛍光 X 線を測定することで
元素分析をすることができる装置です。

この原理を利用した膜厚測定について、職員が実演しながらご説明します。
ご参加お待ちしております。

例えば、このような方に・・・

「蛍光 X 線分析は知っていたが、膜厚が測れることは知らなかった！」

「めっきがきちんとできているかどうか確かめたい！」

「様々な製品のめっきの厚さを比較したい！」

もちろん、

「とりあえず、センターにどんな装置があるか知りたい！」

という方も歓迎します。お気軽にどうぞ。

日 時：平成 31 年 2 月 8 日（金） PM1:30～3:00

場 所：山梨県産業技術センター 研究管理棟 2F 宝石物性測定室

内 容：エネルギー分散型微小部蛍光エックス線分析装置による
膜厚の測定

参加費：無 料

定員

5 名

つぎにご記入頂き、2 月 1 日(金)までに fax して下さい。電話、メールでも結構です。

貴社名		
住 所	〒	
連絡先	TEL:	FAX:
	E-Mail:	
受講者	氏名:	所属:

お申し込み先 **FAX** 055-243-6110 **E-Mail** hayashi-wyhf@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県産業技術センター 食品酒類・研磨宝飾技術部 研磨宝飾科 林、宮川

TEL:055-243-6111 [〒400-0055 甲府市大津町 2094]